

分析技術スクール 2026

～ Analytical Solution Plaza の Open Day ～

2026年 **11月5日** (木) 10:00 - 17:10

会場：株式会社堀場テクノサービス 京都本社



会場地図はこちら

分析技術の最前線に触れ、基礎を学び、装置を体験し、専門家に分析相談できる充実の1日！

最新技術

分析原理
セミナー

装置体験

個別相談

日頃お使いの装置について、「もっと深く理解したい」「原理を改めて学びたい」と感じたことはありませんか。そんな皆さまに向けて、このたび HORIBA 分析技術スクールを開催することとなりました。

このスクールでは、HORIBA の分析エンジニアによる実践的な分析原理セミナーをはじめ、装置デモンストレーション、ラボツアー、個別分析相談をご用意しています。

基調講演では、明星大学 上本道久教授による「機器分析における測定値の評価と信頼性の基礎」、東レリサーチセンター 非常勤技術・経営顧問 吉川正信様による「先端半導体の最新分析技術」を予定しています。

ぜひこの機会にご参加ください。皆さまのお申し込みをお待ちしております。

基調講演 1

機器分析における測定値の評価と信頼性の基礎

機器分析全盛の時代であるが、機器分析装置が出力する数値の意味を理解してその信頼性を評価することは正しくおこなわれているだろうか。本講演では、機器の原理に基づく信号の種類を解説し、測定値を適切に処理して分析値として提示するための基礎を示す。



うえもと みちひさ

講師

上本 道久 明星大学 理工学部 総合理工学科 教授

基調講演 2

先端半導体の最新分析技術

—STEM, NanoSIMS, Near-field Raman, AFM-IR, Cathodoluminescence を中心に—

先端半導体の微細化・高速化、SiC・GaN パワーデバイスの進展を支える最新分析技術に迫る。STEM、NanoSIMS、Near-field Raman、AFM-IR、Cathodoluminescence の特徴を概説し、結晶性・欠陥・不純物をナノメートルスケールで捉えた評価事例を紹介する。



よしかわ まさのぶ

講師

吉川 正信

株式会社東レリサーチセンター
非常勤技術・経営顧問

HORIBA 分析原理セミナー対象装置・講演概要

pH 計測

講師 上田 佳以

pH 測定の原理から測定のコツ、不具合の対応に至るまで、基礎から実践まで幅広くご紹介いたします。

分光エリプソメトリー

講師 和才 容子

非破壊で材料の情報を読み解く、奥深く魅力的な分析手法です。基本原理とわかることを、初めての方にもわかりやすくご紹介いたします。

Raman 分光分析

講師 沼田 朋子

Raman 分光装置は様々な分野で応用が進んでいます。Raman で分かることや、データの見方、測定の注意点をご紹介します。

粒子計測

講師 光成 京子

HORIBA の粒子計測技術の活用事例をご説明するとともに、基本原理を初めての方にもわかりやすくご紹介いたします。

固体中炭素・硫黄/酸素・窒素・水素分析

講師 阪口 真以

試料を加熱・ガス化し、CS/ONH といった軽元素を ppm から % オーダーまで高精度に定量する装置です。原理 / 測定事例をご紹介します。

環境分析 (TP/TN、COD、残留油分)

講師 中西 正顕

全窒素・全りんや COD などの排水分析をはじめ、加工部品の油分残渣分析など、液体分析の基本原則と事例をわかりやすくご紹介いたします。

蛍光 X 線分析

講師 中野 ひとみ

XRF は非破壊で試料中の元素分析ができる分析手法です。その基本原理と、何に利用できるのかを、初めての方にもわかりやすく説明します。

グロー放電発光分光分析

講師 藤本 明良

GD-OES は、深さ方向の元素分析装置です。迅速性・多元素同時分析の特長を活かした、薄膜・めっき・表面処理の分析事例をご紹介します。

開催概要

- 日程 2026 年 11 月 5 日 (木) 10:00 - 17:10
- 費用 無料
- 開催形式 会場受講 (事前予約制)
- 定員 各会場 40 名、合計最大 80 名



セミナー詳細 &
お申し込みはこちら

※ 分析原理セミナーは、A 会場と B 会場で同時開催いたします (選択制)。
※ 1F/2F のラボは随時、自由に見学していただけます。専任ガイドによるツアーをご希望の場合は 16:40 からのラボツアーにご参加ください。
※ 個別分析相談をご希望の方は事前予約をお願いします (1 コマ 30 分)。
※ 2F に休憩スペースをご用意しております。適宜ご利用いただけます。

プログラム

基調講演

分析原理セミナー

時間	A会場 (40 名)	B会場 (40 名)	個別分析相談
9:30 }	会場受付開始		各回 30 分の事前予約制 11:00 ～ 12:30、 14:00 ～ 17:00 まで、 30 分毎に開催
10:00 }	ご案内		
10:10 }	基調講演 1 『機器分析における測定値の評価と信頼性の基礎』 明星大学 上本 道久 教授		
11:00 }			1 枠目 11:00-11:30
11:10 }	pH 計測	固体中炭素・硫黄／酸素・窒素・水素分析	2 枠目 11:30-12:00
11:50 }			3 枠目 12:00-12:30
12:00 }	休憩		4 枠目 14:00-14:30
12:45 }	事前申込要 ランチョンセミナー：受託分析／トレーニング／保守点検などのご紹介（約 20 分）		
13:00 }	ご案内		
13:10 }	基調講演 2 『先端半導体の最新分析技術』 東レリサーチセンター 非常勤技術・経営顧問 吉川 正信 様		5 枠目 14:30-15:00
14:00 }			6 枠目 15:00-15:30
14:10 }	分光エリプソメトリー	環境分析（TP/TN、COD、残留油分）	7 枠目 15:30-16:00
14:50 }			8 枠目 16:00-16:30
15:00 }	Raman 分光分析	蛍光 X 線分析	9 枠目 16:30-17:00
15:40 }			
15:50 }	粒子計測	グロー放電発光分光分析	
16:30 }			
16:40 }	ラボツアー（ご希望者）		
17:10 }			

参加お申し込み

https://pages.horiba.com/SCI-EV-202611-ASPSchool_Registration.html

※上記 Web サイトより必要事項をご入力の上、お申込みください。定員になり次第、締め切らせていただきます。
※お申し込みの締め切りは、10/28 (水) を予定しております。
※個別分析相談につきましては、入力いただいた内容とご希望の時間帯を確認の上、折り返しご連絡をさせていただきます。



お申し込みはこちら

本イベントに関するお問い合わせ

https://pages.horiba.com/SCI-EV-202611-ASPSchool_contact-form.html

※予約内容の確認、キャンセルなどはこちらへお問い合わせください。

主催：株式会社堀場テクノサービス 分析技術本部
共催：株式会社堀場製作所 営業本部



お問い合わせはこちら